近接照明下における画像の線形化の検討

佐藤智 高田 和豊 登 一生

松下電器産業株式会社 先端技術研究所 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-4 E-mail: { sato.satoshi, nobori.kunio, takata.kazutoyo}@jp.panasonic.com

あらまし 物体認識・形状計測・顔認識の精度向上のために,影・鏡面反射・拡散反射の分類が有効 である.このような目的のために,画像の線形化手法を用いる方法が従来,提案されている.しかし, この手法は無限点光源を仮定しているため,近接照明など一般環境に近い光源環境では利用できない という問題があった.本研究では,処理領域の分割と線形化係数組の補間処理を用いることにより, 近接照明下においても利用できる画像の線形化手法を提案する.

Evaluation of Photometric Linearization of images obtained under Point Light Source

Satoshi SATO, Kazutoyo TAKATA and Kunio NOBORI

Advanced Technology Research Laboratories, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 3-4, Hikari-dai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto, 619-0237, Japan E-mail: {sato.satoshi, nobori.kunio, takata.kazutoyo}@jp.panasonic.com

Abstract For the improvement in accuracy of object recognition, 3D measurement, and face recognition, the classification of shadow, specular reflection and diffuse reflection is effective. For this purpose, Photometric Linearization method has been proposed. However, since this method assumed infinite point light source, it has the problem that it cannot use under point light source. In this paper, we propose the Photometric Linearization method under point light source using image partition and interpolation of coefficients of Photometric Linearization.

1. はじめに

物体認識・形状計測・顔認識などにおける性能向上を目 的として,影や反射などの光学現象を分類する手法に関す る研究が報告されている.これは,光源方向,視線方向な どによって光学現象が変化し,画像の見えを大きく変化さ せ,認識性能の低下を引き起こすためである.

光学現象は,図1に示すように,拡散反射,金属などの ハイライト部である鏡面反射,物体表面が光源方向を向い ていないために生じる影である attached shadow,物体表面 が光を遮られるために生じる影である cast shadowの4つに 分類することができる.

梅山[6]はカメラに設置した偏光フィルタを利用し,拡散 反射と鏡面反射相互の確率的独立性を相互情報量を用いて 評価することで,鏡面反射領域を分類する手法を提案した. また, Swaminathan1 ら[7]は,カメラを動かし, EPI(Epipolar Plane Image)を利用して鏡面反射領域を分類す る手法を提案した.また,Ikeuchiら[8]は,レンジファイ ンダーで求めた物体の3次元形状データを利用して,拡散 反射・鏡面反射・影の分類を行う手法を提案した. 石井ら[1]は,画像の線形化手法を用いて,拡散反射・鏡 面反射・attached shadow・cast shadow を分類する手法を提 案した.画像の線形化手法は向川ら[3]によって提案された 手法であり,影や鏡面反射が含まれる実画像から,拡散反 射成分のみの画像(線形化画像)を生成する.画像の線形 化による光学現象の分類手法は,光源方向を変化させた複 数枚の画像を用いるため,分光測定器や偏光フィルタとい った複雑な設備が不要であるというメリットがある.また, 被写体の3次元形状,反射特性,光源情報などを求める必 要もない.さらに対応点探索などの処理も不要であり,大 きなメリットがある.

しかし,線形化手法には,以下の前提条件が存在する. 【前提条件1】光源は無限遠点光源である.

一般に晴れた屋外では、光源は太陽などであるため無限 遠光源と考えられる.一方、家庭内において光源は天井や 机など有限距離に置かれた照明となるため、光源は近接点 光源の集合と考えられる.そのため、画像の線形化手法は 家庭内などの一般環境への適用が困難であった.そこで、 本研究では、より一般的な照明環境である近接点光源環境 において、画像の線形化手法を適用する手法を提案する.



図1 様々な光学現象 Fig.1 Photometric factors.

2. 近接照明下における画像の線形化

本研究では,画像の線形化処理を行う際,まず,画像を 処理領域に分割し,基底画像と呼ばれる線形化画像を3枚 合成する.次に,こうして得られた基底画像を用いて,各 処理領域の線形化係数組を周辺から補間することにより, すべての入力画像を線形化する.さらに,得られた線形化 画像と入力画像を式(1)の分類基準によって比較することで, 影や鏡面反射が含まれる実画像から,拡散反射,鏡面反射, attached shadow, cast shadow に分類する. *Region(k, p)* =

$$\begin{cases} D: & if\left(i_{(k,p)} - i_{(k,p)}^{L}\right) \leq T \cdot i_{(k,p)}\right) \cap \left(i_{(k,p)} \geq T_{s}\right) \\ S: & if\left(i_{(k,p)} - i_{(k,p)}^{L} > T \cdot i_{(k,p)}\right) \\ & \cap \left(i_{(k,p)}^{L} \geq 0\right) \cap \left(i_{(k,p)} \geq T_{s}\right) \\ A: & if\left(i_{(k,p)}^{L} < 0\right) \cap \left(i_{(k,p)} < T_{s}\right) \\ C: & if\left(i_{(k,p)} - i_{(k,p)}^{L} < -T \cdot i_{(k,p)}\right) \cap \left(i_{(k,p)} < T_{s}\right) \end{cases}$$
(1)

U: otherwise

ここで D, S, A, C, U は, それぞれ拡散反射・鏡面反 射・attached shadow・cast shadow・未定義領域である.ま た, $i_{(k,p)}$ は k 番目の入力画像における画素 pの画素値, $i_{(k,p)}^{L}$ は $i_{(k,p)}$ を線形化した画素値を示す.また, T は,本 来の拡散反射成分からどれだけ離れているかを示す閾値で ある. T_s は本来,影領域の画素値は 0 になるはずである が,暗電流特性や感度特性などの影響により,実画像では 0 にならない影響を除去するための閾値である.

2.1 領域分割による画像の線形化の課題

石井ら[1]の画像の線形化手法は,被写体に入射する光源 の入射角は,画像内のすべての画素において等しいという 無限遠点光源を仮定している.一方,家庭内の照明などは 近接点光源の集合として考えられる.無限遠点光源とは, 撮像範囲内の被写体に入射する光の広がりが非常に狭い範 囲に限定されている光源である.一方,近接点光源は入射 角に広がりをもっている光源である.そのため,光源と被 写体との距離と撮像範囲によって,無限遠点光源か近接点 光源かが変化する.そのため,光源と被写体との距離が短 い場合であっても,実際の3次元空間における線形化処理 を行う投影面積が十分に小さければ,無限遠点光源が仮定 でき,画像の線形化処理が可能だと考えられる.

そこで,近接点光源においても画像の線形化を実現する ために,本研究では図2に示したように画像を小領域に分 割し,小領域ごとに線形化処理を行う.また,線形化処理 を行うために分割した小領域を処理領域と呼ぶ.

このように画像を領域分割することで,前提条件1を近 似的に満たすことができるが,画像の線形化には,さらに 以下の2つの前提条件が存在する.

【前提条件 2】被写体表面の法線方向が異なり,かつ表面 が拡散反射成分である 3 点以上の画素が処理領域内に存在. 【前提条件3】拡散反射が画像上で支配的である.

画像の線形化手法は,処理領域が前提条件2,3を満た さない場合,解が不定となる.前提条件1が処理領域が小 さくなればなるほど満足されるのに対し,前提条件2,3 は処理領域が小さくなればなるほど満たされなくなる.

そこで本研究では,主に前提条件2,3を満たすために, 以下の2つの手法について検討した.

・領域分割方法の選択:

領域分割方法の設定が最適でない場合,影や鏡面反射, 単一平面が支配的となり正確な処理が不可能な領域が発生 する.そこで,複数の領域分割方法の中から最適なものを 選択する.

・線形化係数組の補間:

領域分割方法の選択を行っても,点光源,影や鏡面反射, 単一平面の影響のために正確な処理が不可能な領域が発生 する.そこで,近接する処理領域で線形化係数組を補間す る.

2.2 領域分割方法の選択

領域分割方法を変更しながら,画像の線形化を複数回行 い,求めた基底画像において最も確からしいものを選択し, 合成することで基底画像を作成する.ここで,領域分割方 法とは,処理領域の位置・大きさが異なる分割方法のこと である.

領域分割方法を変更することにより,求まる線形化画像 は異なる.これを図3を用いて説明する.

図 3(a)は、平面上に球状物体が置かれている様子を撮像 したものである.このとき、ある処理領域の部分領域であ る region A,B を線形化することを考える.

まず,図 3(a)の点線に従って画像を分割し,処理領域と する.平面上の領域 region A は平面のみしか存在しない処 理領域に属しているため前提条件 2 を満たさず,正確な線 形化画像を求めることができない.一方,平面上の別の領 域 region B は,球状物体と同じ処理領域に含まれるため, 前提条件 2,3 ともに満たす.そのため, region A とは異な り, region B は線形化画像が求まる.

次に,図3(b)の点線に従って画像を分割し,処理領域と する.このとき,region A は球状物体と同じ処理領域に含 まれるため,前提条件2,3をともに満たす.一方,region B は平面のみしか存在しない処理領域に属しているため, 前提条件2を満たさず,正確な線形化画像を求めることが できない.

以上のことから,領域分割方法によって基底画像が生成 できる領域が変化するため,領域分割方法が画像の線形化 に非常に重要であることがわかる.そこで本研究では,ま ず,領域分割方法を変更しながら複数の基底画像候補を求 め,図 3(c)の実線のように,処理領域をさらに再分割した 基底領域ごとに基底画像候補から最適なものを選択し,合 成することで,正確な基底画像を取得する.

このとき,基底領域ごとにどの基底画像候補の画像を利 用するかを決定する評価基準が必要である.このような場 合,基底画像候補と対応する入力画像との基底領域の類似



度を求めることが一般に行われる.しかし,画像の線形化 手法は光源位置を変化させた複数の画像を利用しているた め,図3(a)のregionBのように,基底領域が影や鏡面反射 に覆われ,見えが大きく変化する場合が存在する.そのた め,このような光源移動に基づく輝度変化に対してロバス トな評価基準が必要である.そこで,ここでは隣接画素間 の画素値差に基づく「定性的3値表現」[5]の類似度を利用 した.そこで,本研究では,基底領域ごとに,K 枚の入力 画像と合成した3枚の基底画像候補を定性的3値表現を用 いて比較し,その類似度 QTS が最も高くなるものを基底 画像として合成した.

2.3 線形化係数組の補間(線形化画像の作成)

次に【2】について考える.ある小領域間の線形化係数 組は,近傍の小領域の線形化係数組と相関があると考えら れる.これは,線形化係数組が光源位置情報を内在してい るパラメータと考えられるからである.そこで,基底画像 を用いて,すべての入力画像の線形化画像を作成する際に, 前提条件を満たさず,線形化係数組が求まらなかった場合, 近傍領域の線形化係数組を利用することで線形化画像を生 成する.

ここでは, nearest neighbor に基づいた手法を利用する.

2.4 処理の流れ

(1) 基底画像の合成

以下の関係式を満たす基底画像 \mathbf{I}_1^B , \mathbf{I}_2^B , \mathbf{I}_3^B をRAN SAC[2]を利用して合成する.

$$\mathbf{I}_{k}^{L} = c_{k}^{1} \mathbf{I}_{1}^{B} + c_{k}^{2} \mathbf{I}_{2}^{B} + c_{k}^{3} \mathbf{I}_{3}^{B}$$
⁽²⁾

ここで, \mathbf{I}_{k}^{L} は k 番目の入力画像の線形化画像である. 1) K 枚の入力画像から,3枚の基底元画像 \mathbf{I}_{1} , \mathbf{I}_{2} , \mathbf{I}_{3} を選択する.

²2)K 枚の入力画像をある領域分割方法で処理領域に分 割する.

3)処理領域ごとに,基底元画像 \mathbf{I}_1 , \mathbf{I}_2 , \mathbf{I}_3 から,残 りの入力画像 \mathbf{I}_k (k=4,5,6,...,K)について,以下の関 係式を満足する線形化係数組 $\mathbf{c}_k = \begin{bmatrix} c_k^1 c_k^2 c_k^3 \end{bmatrix}^r$ をそれぞれ算出 する.

$$\mathbf{I}_{k} = c_{k}^{1} \mathbf{I}_{1} + c_{k}^{2} \mathbf{I}_{2} + c_{k}^{3} \mathbf{I}_{3}$$
(3)

ランダムに 3 点(p1,p2,p3)を選択し, この 3 点における基 底元画像と各入力画像の画素値 $i_{(k,p)}$ と式(3)の関係から, 以下の方程式を導き,これを解くことで係数組の解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ を算出する.

$$\begin{cases} i_{(k,p1)} = c_k^1 i_{(1,p1)} + c_k^2 i_{(2,p1)} + c_k^3 i_{(3,p1)} \\ i_{(k,p2)} = c_k^1 i_{(1,p2)} + c_k^2 i_{(2,p2)} + c_k^3 i_{(3,p2)} \\ i_{(k,p3)} = c_k^1 i_{(1,p3)} + c_k^2 i_{(2,p3)} + c_k^3 i_{(3,p3)} \end{cases}$$
(4)

4)係数組の解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k \geq \mathbf{I}_1$, \mathbf{I}_2 , \mathbf{I}_3 を利用して, 線 形化画像 \mathbf{I}_k^L を算出し,以下の評価関数で評価する.

Support^C(k) =
$$\sum_{p} Classifiab le(k, p)$$
 (5)
Classifiable(k, p) –

$$\begin{cases} 1 & if (Region(k, p) = D \cup A \cup C) \\ 0 & if (Region(k, p) = S \cup U) \end{cases}$$
(6)

得られた解候補が正しければ,式(1)に従って分類した各 画素は,拡散反射・鏡面反射・attached shadow・cast shadowのいずれかに必ず分類され,未定義領域になること はない.また画面内において鏡面反射となる割合が少ない ため,評価関数(5)によって解候補のもっともらしさを評 価することができる.

ここで,入力画像の画素値が閾値 T_s 以下であれば,式 (6)は必ず1となる.そのため,評価関数(5)は,拡散反射領 域が支配的であるときのみ正確に機能する(前提条件3).

5)別の3点を選択し、3)~4)の処理を繰り返す. この処理を十分な回数行った後、式(5)の評価関数を最大に する解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ を線形化係数組 \mathbf{c}_k とする.

6)4~K 枚目の入力画像からランダムに 3 枚(k1,k2,k3) を選択し,選択した 3 枚の入力画像の画素 p の画素値 $i_{(k,p)}$ と,5)によって得られた線形化係数組 \mathbf{c}_k から方程 式(7)を導き,これを解くことにより,基底画素値の解候補 $\hat{\mathbf{i}}_p^B = \begin{bmatrix} \hat{i}_{(1,p)}^B & \hat{i}_{(2,p)}^B & \hat{i}_{(3,p)} \end{bmatrix}$ を求める.

$$\begin{cases} \dot{i}_{(k1,p)} = c_{k1}^{1} \dot{i}_{(1,p)}^{B} + c_{k1}^{2} \dot{i}_{(2,p)}^{B} + c_{k1}^{3} \dot{i}_{(3,p)}^{B} \\ \dot{i}_{(k2,p)} = c_{k2}^{1} \dot{i}_{(1,p)}^{B} + c_{k2}^{2} \dot{i}_{(2,p)}^{B} + c_{k2}^{3} \dot{i}_{(3,p)}^{B} \\ \dot{i}_{(k3,p)} = c_{k3}^{1} \dot{i}_{(1,p)}^{B} + c_{k3}^{2} \dot{i}_{(2,p)}^{B} + c_{k3}^{3} \dot{i}_{(3,p)}^{B} \end{cases}$$
(7)

前提条件2を満たさない場合,この方程式は不定となる.

7) 求めた解候補 \mathbf{i}_{p}^{B} と線形化係数組 \mathbf{c}_{k} との線形結合により,全入力画像に対応する線形化画像の画素値 $i_{(k,p)}^{B}$ を算出し,以下の評価関数で評価する.

$$Support^{B}(p) = \sum_{k} Classifiable(k, p)$$
⁽⁸⁾

8)別の3枚を選択し,6)~7)の処理を繰り返す. この処理を十分な回数行った後,式(10)の評価関数を最大にする解候補 \mathbf{i}_p^B を基底画素値 \mathbf{i}_p^B とする.

9)処理を行う画素 p を変更し,処理領域内すべての画素の基底画素値 \mathbf{i}_p^B が求まるまで6)~8)を繰り返す

10) すべての処理領域に対し,以上の処理を行う.

11)処理領域の領域分割方法を変更しながら1)~10)の処理を複数回行い,複数の基底画像を作成する.ここで,切り出し位置Sで得られた基底画像を $\begin{bmatrix} I_{S1}^{B} & I_{S2}^{B} & I_{S3}^{B} \end{bmatrix}$ とする.

12) こうして得られた複数の基底画像を基底領域に分割 し,基底領域ごとに定性的3値表現を求め,入力画像との 類似度を以下の評価関数を用いて計算する.

$$\widetilde{S} = \sum_{j=1}^{K} \sum_{i=1}^{3} \sum_{x, y \in m} QTS(\mathbf{I}_{Si}^{B}(x, y), \mathbf{I}_{j(x, y)})$$
(9)

すべての基底画像で評価関数を計算し,領域ごとに評価 関数を最小にする基底画像をその領域の基底画像とし,各 領域を合成することで基底画像を求める.

(2)入力画像の線形化

式(2)に従って,各入力画像の線形化係数組 \mathbf{c}_{k} と基底画像 \mathbf{I}_{1}^{B} , \mathbf{I}_{2}^{B} , \mathbf{I}_{3}^{B} の線形結合によって,すべての入力画像 \mathbf{I}_{k} の線形化画像 \mathbf{I}_{k}^{L} を作成する.

1) K 枚の入力画像と3 枚の基底画像をある領域分割方 法で処理領域に分割する.

2) k 番目の入力画像において,ランダムに3点 (p1,p2,p3)を選択し,この3点における基底画像 $i^{B}_{(1,p1)}$, $i^{B}_{(2,p1)}$, $i^{B}_{(3,p1)}$ と各入力画像の画素値 $i_{(k,p)}$ と式(3)の関係から,以下の方程式を導き,これを解くことで係数組の解候 補 $\hat{\mathbf{c}}_{k}$ を算出する.

$$\begin{cases} i_{(k,p1)} = c_k^1 i_{(1,p1)}^B + c_k^2 i_{(2,p1)}^B + c_k^3 i_{(3,p1)}^B \\ i_{(k,p2)} = c_k^1 i_{(1,p2)}^B + c_k^2 i_{(2,p2)}^B + c_k^3 i_{(3,p2)}^B \\ i_{(k,p3)} = c_k^1 i_{(1,p3)}^B + c_k^2 i_{(2,p3)}^B + c_k^3 i_{(3,p3)}^B \end{cases}$$
(10)

ここで,以下の行列**C**の条件数を評価することで,前提 条件 2,3 を評価することができる.そこで,**C**の条件数 が閾値より小さい場合,求めた解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ を廃棄し,別の 3点を選択し,再度処理を行う.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} i_{(1,p1)}^{B} & i_{(2,p1)}^{B} & i_{(3,p1)}^{B} \\ i_{(1,p2)}^{B} & i_{(2,p2)}^{B} & i_{(3,p2)}^{B} \\ i_{(1,p3)}^{B} & i_{(2,p3)}^{B} & i_{(3,p3)}^{B} \end{pmatrix}$$
(11)

3)係数組の解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ が得られた場合,式(2)に従って 線形化画像 \mathbf{I}_k^L を算出し,評価関数式(5)で評価する.

4) 別の 3 点を選択し,2)~3)の処理を繰り返す. この処理を十分な回数行った後,評価関数式(5)を最大にする解候補 \mathbf{i}_{p}^{B} を基底画素値 \mathbf{i}_{p}^{B} とする.

5) 十分な回数処理を行った後,行列Cの条件数の評価 によって線形化係数組が得られなかった場合,処理領域 (X,Y) (図4における黒色実線の領域)の8近傍領域(図4における白色実線の領域)の線形化係数組のいずれかを, $係数組の解候補<math>\hat{c}_k$ とする.

6)係数組の解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ と基底画像を利用して,線形化画像 \mathbf{I}_k^L を算出し,以下の評価関数で評価する.

$$Func(i_{k(X,Y)}^{L}) = g_{(X-l,Y)} \left(\sum_{y=1}^{n} \left| i_{(k,X,Y,l,y)}^{L} - i_{(k,X-l,Y,m,y)}^{L} \right| \right) + g_{(x,y-l)} \left(\sum_{x=1}^{m} \left| i_{(k,X,Y,x,l)}^{L} - i_{(k,X,Y-l,x,n)}^{L} \right| \right)$$



図4 近傍領域 Fig.4 Neighbor region.

$$+ g_{(X+1,Y)} \left(\sum_{y=1}^{n} \left| i_{(k,X,Y,m,y)}^{L} - i_{(k,X+1,Y,1,y)}^{L} \right| \right) + g_{(x,y+1)} \left(\sum_{x=1}^{m} \left| i_{(k,X,Y,x,n)}^{L} - i_{(k,X,Y+1,x,1)}^{L} \right| \right)$$
(12)

ただし,

 $g_{(X,Y)}(f) = \begin{cases} f : 領域(X,Y) の線形化係数組が <math>\Re$ っている 0:領域(X,Y) の線形化係数組が \Re っていない

ここで,処理領域の画素数はすべて(m×n)画素, $i_{(k,X,Y,x,y)}^{L}$ は入力画像kの処理領域(X,Y)の画素(x,y)の線形 化画素値を示している.この評価関数は,処理領域の最外位置 の画素値は,その画素に隣り合った近傍領域の画素値と等しい と仮定し,この連続性を数値化したものである.

7)別の8近傍領域を選択し、その線形化係数組を処理 領域の解候補 \hat{c}_{i} とし、5)の処理を繰り返す.

8)8 近傍領域すべての線形化係数組で処理を行った後, 式(12)の評価関数を最大にする解候補 $\hat{\mathbf{c}}_k$ を処理領域(X,Y)の線形化係数組 \mathbf{c}_k とする.

9) すべての領域に対し,以上の処理を行い,k番目の入力画像における線形化画像 \mathbf{I}_{k}^{L} を生成する.

10) K枚すべての入力画像において2)~9)の処理を 繰り返し,すべての入力画像の線形化画像 \mathbf{I}_k^L を生成する.

(3)入力画像の光学的分類

こうして得られた線形化画像と入力画像を式(1)の分類基準によって比較することで,光学的分類を行う.

実験結果と考察

本提案法の有効性を示すために,近接点光源を配置した CG画像によってシミュレーションを行った.鏡面反射成 分を持たない平面上に,鏡面反射成分を有する半径100mm の半球を4個配置し,水平画角56°,640x480 画素のカメ ラを上方500mmの位置に設置した.また,処理領域の大 きさは80x80 画素とした.つまり,処理領域の面積におけ る視野は約5°である.また,光源位置を撮像対象物中心 から600mm~1200mmの距離において変化させた24枚の 画像(図5~11(a)はその一例)を撮影し.この画像を入力 画像として線形化画像を作成し,光学現象の分類を以下の 3つの手法で行った.

従来法.

固定の領域分割方法によって分割した領域ごとに処理 を行い,線形化係数組の補間処理を行った「線形化係 数組補間法」. 提案法. 図 6~8 は従来法[1],線形化係数組補間法,提案法によって作成された基底画像を,また,図 9~11 はそれぞれの 手法において作成された線形化画像と分類された各光学成 分と分類失敗領域を示す.図 8(d)からわかるように,従来 法では広い領域で拡散反射成分を鏡面反射成分として分類 しているが,図 10 の提案法では鏡面反射と拡散反射, attached shadow, cast shadow の境界領域を除いて分類にほ ぼ成功している.

また,線形化係数組補間法では,図 5~7(c)からわかる ように,鏡面反射成分が基底画像に残ってしまっているこ とがわかる.これは,この処理領域において鏡面反射成分 が支配的になってしまったためである.一方,提案法では このような問題は生じていない.このことから,本手法は 処理領域の取り方に影響を受けにくい手法であるといえる

一方,提案手法では,入力画像の多くが影領域となって いる左下の球における右上の領域において,誤差が生じて いることがわかる(図 7(d),図 10(h)).このように,複 数の入力画像において,影が支配的となる領域が存在する 場合や,広い領域において前提条件 2,3 を満たさない場 合,本手法の精度は劣化する.

処理領域の大きさをどのように決定するかは課題である 今回は,処理領域の面積における視野が 5°になるように 選択したが,本来は撮像対象によって最適な値を選択すべ きである.そこで,領域分割方法として,その位置だけで なく大きさも変更するようにすることで,撮像対象物の情 報がない場合であっても,最適な大きさの処理領域を選択 することも可能である.

図 11 は別の入力画像に対して処理を行った結果である この結果より,より複雑な対象物においても本手法が効果 的であることがわかる.

表 1 はこの処理を 24 枚の入力画像すべてに対して行っ た際の鏡面反射成分と拡散反射成分の分類精度を示したも のである.分類精度は,入力画像中の拡散反射と鏡面反射 の画素数のうち,正確に分類された割合を示している.こ の結果から,近接照明下において,本提案手法は従来法よ り優れていることがわかる.

4. まとめ

本稿では,近接照明下においても利用できる画像の線形 化手法を提案した.画像を処理領域に分割し,領域間で線 形化係数組に強い相関があることを利用した.さらに,領 域分割のための領域分割方法を変更しながら基底画像を合 成した.また,CG画像を利用して,近接照明下において, 本手法が効果的であることを定量的に示した.今後は,実 画像において本手法を適用し,その有効性の検討を行う予 定である.

表 1. 実験結果 Table 1 Classification Result of Photometric factors.

	従来法[1]	提案手法
分類精度	80%	95%





(a)入力画像

(b)従来法





(c)線形化係数組の補間

(d)提案法

図 5 基底画像 1 Fig.5 Base Image No.1

参考文献

- [1] 石井育規,福井孝太郎,向川康博,尺長健,"光学現象の分類に基づく画像の線形化,"情報処理学会論文誌: コンピュータビジョンとイメージメディア,vol.44, No.SIG5(CVIM6), pp. 11–21, 2003.
- [2] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography", Communications of the ACM, Volume 24, Issue 6, pp. 381-395, 1981.
- [3] 向川康博,宮木一,三橋貞彦,尺長健, "Photometric Image-Based Rendering による仮想照明画像の生成," 情 報処理学会論文誌:コンピュータビジョンとイメージ メディア, vol.41, No.SIG10(CVIM1), pp. 19–30, 2000.
- [4] Shashua,A., "Geometry and Photometry in 3D Visual Recognition," Ph.D. thesis, Dept. Brain and Cognitive Sceience, NIT, 1992.
- [5] 山口修,福井和広、"定性的3値表現に基づく画像マッチング、"電子情報通信学会技術報告:パターン認識・メディア理解、vol.2002-34、pp. 23–30, 2002.
- [6] 梅山伸二, "物体の見えからの拡散 / 鏡面反射成分の分離 -- 偏光フィルタを介した多重観測と確率的独立性を用いて --", 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2002)論文集, Vol.1, pp.469-476, 2002.
- [7] R. Swaminathan1, S. B. Kang, R. Szeliski, A. Criminisi, and S. K. Nayar1, "On the Motion and Appearance of Specularities in Image Sequence Sequences", Proc. Of ECCV, vol.1, pp.508-523, 2002
- [8] K. Ikeuchi, and K. Sato, "Determining Reflectance Properties of an Object Using Range and Brightness Images", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.13, no.11, pp.1139-1153, 1991

